# Cu(110)表面でのアジピン酸の吸着状態<sup>†</sup>

# 柳生進二郎・吉武道子・知京豊裕

物質・材料研究機構 ナノマテリアル研究所 📼 305-0003 茨城県つくば市桜 3-13

(2005年2月17日受付; 2005年5月16日掲載決定)

#### Adsorption Structure of Adipic Acid on Cu(110) Surfaces

Shinjiro YAGYU, Michiko YOSHITAKE and Toyohiro CHIKYOW

Nanomaterials Laboratory, National Institute for Materials Science 3–13, Sakura, Tsukuba, Ibaraki 305–0003

(Received February 17, 2005; Accepted May 16, 2005)

We have investigated thermal stability and adsorption structure of adipic acid (HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-COOH) on Cu(110) surfaces as a function of sample temperature using temperature programmed desorption (TPD), low energy electron diffraction (LEED) and fourier transform infrared adsorption spectroscopy (FT-IRAS). From 350 to 400 K, adipic acid adsorbed as monoadipiate (HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-COO<sup>-</sup>) forms corresponding structure of  $c(2 \times 2)$ . As the temperature increases until about 600 K, monoadipiate changes to biadipiate (<sup>-</sup>OOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-COO<sup>-</sup>) corresponding structure of  $p(1 \times 2)$  or  $p(6 \times 2)$ . Biadipiate structure is stable until 600 K and then desorption occurred.

### 1. はじめに

近年、カルボン酸やアミノ酸などの有機分子と金属表 面との相互作用の研究が、生体材料やセンサー(分子認 識)などの応用から注目されてきている。我々は、特に カルボン酸とSiテクノロジーで重要な配線材料である Cu との相互作用について研究を行っている。カルボキ シル基を持つ分子で最も単純な構造であるギ酸(Formic acid; H-COOH)のCu(110)表面での吸着状態は、紫外 線光電子分光法 (UPS), X線光電子分光法 (XPS) や X 線吸収端微細構造解析法 (NEXAFS), 高分解能電子 線損失分光(HREELS),フーリエ変換反射吸収赤外分 光(FT-IRAS)によって良く研究されている<sup>1~12)</sup>。ギ酸 イオンは、Cu(110)の短軸([110] 方位で原子間距離 は、a/√2=2.55Å, a=3.61Å)のCu原子のブリッジサ イトに吸着する。(Cu 原子のオントップに酸素原子が位 置し Cu-O-C-O-Cu で共鳴構造を作っていると考えられ ている。) また,(100) および(111)の低指数面でも a/√2 の原子間距離は存在するために、同様の吸着構造が存在 する。また、ギ酸よりも炭素数が1つ多い酢酸(Acetic acid; CH3-COOH) においても同様な吸着構造が報告さ れている2)。このようにカルボキシル基は、金属表面で 化学結合を作るため、分子の固定化(アンカー)材料と して有力である。この分子とSi系デバイスとの融合を 考えた場合、その固定化分子の熱的安定性や吸着構造が 重要である。これまで我々は、カルボキシル基が1つで ある酢酸とカルボキシル基が2つであるコハク酸の吸着 構造および熱的安定性について報告した14)。酢酸に比べ てコハク酸の方が脱離温度が高く熱的安定性が高いこと が明らかになった。これは、コハク酸の2つあるカルボ キシル基のうち2つともイオン化してCu原子に吸着し ている状態(Bisuccinate: -OOC-CH2-CH2-COO-)であ るために、脱離温度が高くなったと考えられる。本研究 では、メチレン基が2つ多いアジピン酸を用いて、炭素 数の違いが熱的安定性に与える影響および吸着構造につ いて昇温脱離,低速電子線回折(LEED)およびFT-IRAS を用いて検討を行った。

#### 2. 実 験

実験装置として LEED/オージェ電子分光 (AES), FT-IRAS,四重極質量分析計 (QMS) およびイオンガンが 設置されている超高真空装置を用いた。サンプルとして Cu(110)単結晶表面を用い,そのクリーニングは、1 kV

<sup>\*</sup> 第24回表面科学講演大会(2004年11月8日~11月10日)にて発表

E-mail: YAGYU.Shinjiro@nims.go.jp

のアルゴンイオンスパッタと 750 K でのアニールを繰り 返すことによって行った。AES にて Cu 元素以外が検出 されないことより清浄性を確認した。アジピン酸は、常 温で白い粉末である。ガラス製の坩堝にアジピン酸を入 れ、およそ 370 K 程度加熱することでアジピン酸の蒸着 を行った。清浄表面に室温にておよそ 10 Langmuir 導入 し、c(2×2) 構造のアジピン酸イオン (adipiate)の吸 着表面を作成した。その後、温度変化による測定をそれ ぞれ行った。

#### 3. 実験結果および考察

## 3.1 熱的安定性計測(昇温脱離(TPD))

室温にて蒸着したアジピン酸の昇温脱離スペクトルを Fig.1に示す。昇温速度は1K/sであり、測定した質量 数は2,28,44 および27 amu. である。27 amu. は,ア ジピン酸由来の質量数である13)。測定したすべての質量 数で、590K付近に脱離のピークが観測された。質量数 44 amu. では、わずかではあるが 400 K 付近から強度の 増加が見られ、550Kより急激に増加している。また、 昇温速度を2K/sで行ったTPD実験では、測定したす べての質量数でピーク位置が高温度側に移動した。この ことから1次の脱離であると考えることができる。また 脱離の活性化エネルギーを求めるとおよそ2eV であっ た。この結果は、コハク酸での TPD 測定結果とほぼ一 致をしている14~16)。コハク酸とアジピン酸の違いは炭 素(メチレン基)数の違いであり、炭素数が変わっても 脱離温度がほぼ同じであることより,表面との結合性は, カルボキシルイオンが決定していると考えることができ る。

3.2 2次元構造計測(低速電子線回折(LEED)) 室温にてアジピン酸を蒸着した後,各温度まで加熱し



Fig. 1. TPD spectra for adipic acid on Cu(110). The initial adsorption structure of  $c(2 \times 2)$  was created at 350 K. The measured masses were  $2(H_2)$ , 28(CO),  $44(CO_2)$  and 27 (adipic acid) amu., and the heating rate was 1 K/s. The solid line is the background level.

室温にて測定した LEED 像を Fig. 2 (a) に示す。また, その回折点を書き写したものおよび回折点をもとに実空 間に変換した図を Fig. 2 (b) に示す。LEED 測定におけ る 1 次電子のエネルギーは 60 eV である。また各温度ま での昇温速度は、TPD 測定と同様に 1 K/s である。Fig. 2 (b) における黒丸は、Cu (110) の基本構造である。310 K および 350 K では c(2×2) 構造を示す。その後加熱 により (±1/2, ±1/2) のスポットは弱くなり c(2×2) 構造は崩れ、500 K では p(1×2) 構造になる。530~570 K では p(6×2) 構造を示す。(Fig. 2 (a) の 530 K およ び 550 K の像では、(±1/6, ±1/2)、(±1/6, ±1) の





Fig. 2. (a) LEED patterns measured at room temperature after following annealing temperatures: 310 K, 350 K, 400 K, 450 K, 500 K, 530 K, 550 K, 570 K and 600 K. The primary electron energy was 60 eV. (b) The schematic spots and real space unit cells represented by these LEED patterns. Filled circles were Cu(110) original spots.

スポットが強く見られるが,1次電子のエネルギーを変 えた測定から [110] 方向に6倍の周期構造が得られて いる。)600 K 以降では Cu(110)の基本構造が現れる。

# 3.3 吸着分子の同定および3次元構造計測(フーリ 工変換反射吸収赤外分光(FT-IRAS))

LEED 測定と同様に室温にてアジピン酸を蒸着して c (2×2) 構造を作成し,各温度まで加熱し 350 K で測定 した IRAS スペクトルを Fig. 3 (a) に示す。なお,310 K はその温度で測定している。また,1,400 cm<sup>-1</sup> 付近を 拡大した図を Fig. 3 (b) に示す。600 K 以上では,特徴 的なピークは見られなかった。570 K 以下では,2,900, 1,650 および 1,400 cm<sup>-1</sup> 付近で特徴的なピークが見られ る。2,900 cm<sup>-1</sup> 付近ピークは CH<sub>2</sub> 伸縮に関するピーク であり,2,935 cm<sup>-1</sup> は逆対称伸縮 (v<sub>as</sub>(CH<sub>2</sub>)) であり, 2,881 cm<sup>-1</sup> は対称伸縮 (v<sub>s</sub>(CH<sub>2</sub>)) であると考えられる。





**Fig. 3.** (a) FT-IRAS spectra measured at 350 K after following annealing temperatures: 310 K, 350 K, 400 K, 450 K, 500 K, 530 K, 550 K, 570 K and 600 K. (b) Expanding Fig. 3 (a) at around 1,400 cm<sup>-1</sup>.

1,650 cm<sup>-1</sup> 付近ピークは、カルボン酸由来の C=O 逆対 称伸縮 (vas(C=O)) であると考えられる。カルボン酸 由来の C=O のピークは、コハク酸や酒石酸<sup>15,16)</sup>では、 1,700 cm<sup>-1</sup> 付近に現れることが報告されているが、結果 ではこれらに比べ低くなっている。これは、カルボン酸 同士が水素結合によりダイマー化したためであると考え られる。また、対称伸縮 (vs(C=O)) は、Nujol サンプ ルなどを用いた赤外スペクトルでも測定されない13)。 1,400 cm<sup>-1</sup> 付近のピークは、カルボン酸イオンに由来す る OCO の対称伸縮である。Nujol サンプルの赤外スペ クトルでは、カルボン酸イオンに由来するピークは、逆 対称伸縮(1,600 cm<sup>-1</sup>)と対称伸縮(1,400 cm<sup>-1</sup> 付近) の2つが観測される13,18)。実験結果では逆対称伸縮は 観測されていない。これまでギ酸などで提案されている 表面 Cu 原子のブリッジサイトにカルボキシルイオンの 吸着を仮定し、そして IRAS は、表面垂直方向のダイポ ールモーメントの変化しか観測できないことより、逆対 称伸縮は赤外で不活性になったと説明することができ る。したがって310,350Kおよび400Kでは、2つあ るカルボキシル基のうち1つはカルボキシル基で、もう 1つはカルボキシル基の水素が外れている状態 (Monoadipiate) で吸着しており、そして、隣り合う別 のカルボキシル基同士で水素結合 (-CO(OH)・・・O (OH)C) を作りダイマー構造になっていると考えられ る。このようにダイマー構造を作ることは、コハク酸で の走査型トンネル電子顕微鏡(STM)による測定でも 報告されている<sup>16)</sup>。また、450 K から、1,427 cm<sup>-1</sup> のピ ークのほかに新たに 1,417 cm<sup>-1</sup> にピークが現れてくる。 このピークは温度が高くなるにつれてはっきりしてくる のがわかる。これは、2つの同等な OCO 振動子のカッ プリングのために生じたと考えられ、2つあるカルボキ シル基の両方の水素が外れ吸着している状態 (Biadipiate) になったと考えることができる。このようなこと は、Cu(110) 表面での酒石酸、コハク酸でも観測され ている15, 16, 19)。

#### 3.4 吸着ダイアグラム

これまでの結果をまとめると Fig. 4 のようになる。室 温 に て 蒸 着 後 は  $c(2 \times 2)$  構 造 を 示 し, 隣 り 合 う Monoadipiate は,水素結合をつくりダイマーを形成して いる。温度の上昇に伴い,次第に  $c(2 \times 2)$  構造が崩れ, それと同時に分子の脱離が徐々に起こる。その後, biadipiate になりさらに分子の脱離が進み,  $p(1 \times 2)$  お よび  $p(6 \times 2)$  構造へ変化する。そして,600 K 付近で biadipiate の脱離が起こる。



**Fig. 4.** The adsorption phase diagram summarizing the molecular adsorption states and ordered overlayer structures observed as a function of temperature.

4. 結 論

昇温脱離法 (TPD),低速電子線回折 (LEED) および, フーリエ変換反射吸収赤外分光 (FT-IRAS)を用いて, アジピン酸の熱的安定性および吸着構造についての実験 を行った。アジピン酸は、600 K 付近で脱離をし、これ は炭素数が2つ少なく分子構造が似ているコハク酸の結 果とほぼ一致した。脱離温度は、表面 Cu 原子と吸着し ているカルボキシルイオンが決定していると考えられ る。室温でのアジピン酸蒸着によって得られた c(2×2) 構造は、温度の上昇とともに崩れ、500 K では p(1×2) 構造では、2つあるカルボキシル基のうち1つがイオン 化して吸着している状態 (Monoadipiate) であると考え られる。p(1×2) および p(6×2) 構造では、2つあるカ ルボキシル基の両方がイオン化して吸着している状態 (Biadipiate) であると考えることができる。

## 文 献

- K.-U. Weiss, R. Dippel, K.M. Schindler, P. Gardner, V. Fritzsche and A.M. Bradshaw: Phy. Rev. Lett. 69, 3196 (1992).
- 2) A.M. Bradshaw: Surf. Sci. 331-333, 978 (1995).
- 3) B.A. Sexton: J. Vac. Sci. Technol. 17, 141 (1980).
- P. Baumann, G. Pirug, D. Reuter and H.P. Bonzel: Surf. Sci. 335, 186 (1995).
- W. Erley and D. Sander: J. Vac. Sci. Technol. A 7, 2238 (1989).
- J. McCarty, J. Falconer and R.J. Madix: J. Vac. Sci. Technol. 11, 266 (1974).
- D. Sander and W. Erley: J. Vac. Sci. Technol. A 8, 3357 (1990).
- 8) A.P. Graham: J. Chem. Phys. 115, 524 (2001).
- P. Stone, S. Poulston, R.A. Bennett, N.J. Price and M. Bowker: Surf. Sci. 418, 71 (1998).
- 10) M.P. Seah: Appl. Surf. Sci. 144/145, 161 (1999).
- A.F. Carley, P.R. Davies and G.G. Mariotti: Surf. Sci. 401, 400 (1998).
- 12) J. Hasselström, O. Karis, M. Weinelt, N. Wassdahl, A. Nilsson, M. Nyberg, L.G.M. Pettersson, M.G. Samant and J. Stöhr: Surf. Sci. 407, 221 (1998).
- SDBSWeb: http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/ (adipic acid, L-tartaric acid, succinic acid)
- S. Yagyu, M. Yoshitake and T. Chikyow: Appl. Surf. Sci. 241, 183 (2005).
- S.M. Barlow and R. Raval: Surf. Sci. Reprt. 50, 201 (2003).
- 16) V. Humblot, M.O. Lorenzo, C.J. Baddeley, S. Haq and R. Raval: J. Am. Chem. Soc. **126**, 6460 (2004).
- 17) 表面科学会編:"ナノテクノロジーのための表面電 子線回折法"(丸善株式会社, 2003) p. 69.
- 18) 荒木 峻,益子洋一郎,山本 修,鎌田利紘訳:"有 機化合物のスペクトルによる同定法"(東京化学同 人, 2003) p. 85, p. 99.
- M.O. Lorenzo, V. Humblot, P. Murray, C.J. Baddeley, S. Haq and R. Raval: J. Catal. **205**, 123 (2002).